

ПОЛЮС БАС

**Инспекционный микроскоп для
контроля качества
полупроводниковых изделий MX8R**

**Техническая
информация**

Инспекционный микроскоп для контроля качества полупроводниковых изделий MX8R



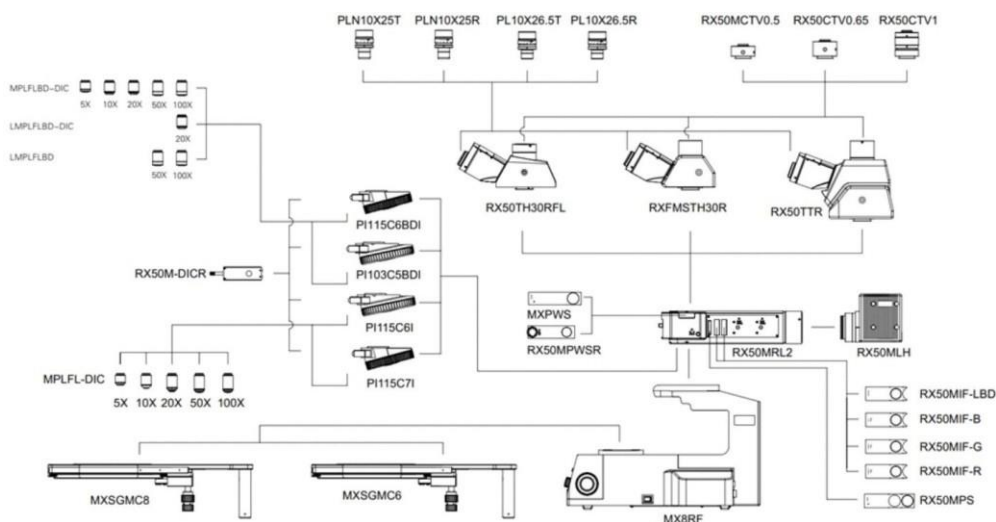
Модель инспекционного микроскопа MX8R оснащена 8- дюймовой рабочей платформой, а также имеет улучшенный эргономичный дизайн, обеспечивающий быстроту управления, равномерность освещения и высокую чёткость изображения.

Основные преимущества

- Широкоугольная система получения изображения (максимальное поле зрения достигает 26,5 мм);
- Тринокулярная головка со светоделительными призмами 100:0 или 0:100, обеспечивающими 100% вывод изображения с окуляров или камеры, либо со светоделительными призмами 20:80, обеспечивающими двустороннюю передачу изображения на 20% от окуляров и на 80% от камеры;
- Цельнометаллическая рама с низким центром тяжести, гарантирующая стабильность и четкость изображения;
- Револьверная головка с прецизионным подшипником, предназначенная для простоты и удобства управления;
- 8-дюймовый трехслойный механический столик для образцов размером 525 мм × 330 мм с диапазоном перемещения: 210 мм × 210 мм и 6-дюймовый столик для образцов размером 445 мм × 240 мм с диапазоном перемещения: 158 мм × 158 мм.



Схема инспекционного микроскопа MX8R



Аксессуары для инспекционного микроскопа MX8R

ОКУЛЯРЫ С ШИРОКИМ ПОЛЕМ ЗРЕНИЯ



- Окуляр 10X/25 мм для сохранения чёткости изображения по всему полю зрения;
- Окуляр 10X/26,5 мм позволяет получить максимально возможное поле зрения.

ОБЪЕКТИВЫ С БОЛЬШИМ РАБОЧИМ РАССТОЯНИЕМ



- В серии профессиональных полуапохроматических металлографических объективов установлены высококачественные линзы с просветляющим покрытием;
- Объективы с увеличенным рабочим расстоянием эффективно предотвращают повреждения образца.

Доступные объективы

Объектив	Кратность увеличения	Числовая Апертура (N.A.)	Рабочее фокусное расстояние, мм	Парфокальное – сопряжённое фокусное расстояние, мм
Полуапохроматический металлографический ДИК-объектив с бесконечной фокусировкой в светлом и темном поле	5X	0.15	13.5	45 - ∞
	10X	0.30	9.0	
	20X	0.50	2.5	
	50X	0.80	1.0	
	100X	0.90	1.0	
Полуапохроматический металлографический объектив с бесконечно длинной фокусировкой в светлом и темном поле	20X	0.40	8.5	45 - ∞
	50X	0.55	7.50	
	100X	0.80	2.10	
Полуапохроматический ДИК-объектив с бесконечной фокусировкой в светлом поле	5X	0.15	19.5	45 - ∞
	10X	0.30	10.9	
	20X	0.50	3.2	
	50X	0.80	1.2	
	100X	0.90	1.0	

СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННО-КОНТРАСТНОЙ МИКРОСКОПИИ
(ДИК-микроскопия Номарского)



- При наблюдении в отраженном свете, ДИК-микроскопия позволяет создать объемное рельефное изображение за счет контрастности, зависящей от перепадов высоты на исследуемой поверхности;
- ДИК-микроскопия широко применяется для обнаружения дефектов (частиц, царапин) при проведении визуального контроля изделия.

Основные технические характеристики инспекционного микроскопа MX8R

Оптическая система	скорректированная на бесконечность
Режим наблюдения	светлое поле / Темное поле / Поляризация / ДИК-микроскопия
Тубус	тринокулярная головка на 5-35° (перевернутое изображение), регулировка межзрачкового расстояния на 50-76мм, деление светового потока: 50:50, 100:0 или 0:100
	тринокулярная головка с углом наклона 30° (прямое изображение), регулировка межзрачкового расстояния на 50-76мм, деление светового потока: 100:0 или 0:100
	тринокулярная головка с углом наклона 30° (прямое изображение), регулировка межзрачкового расстояния на 50-76мм, деление светового потока: 100:0 или 20:80 или 0:100
Окуляры	PL10X/25 мм - с высокой окулярной точкой, широким полем зрения и с диоптрической настройкой (окулярная сетка – опция)
	PL10X/26,5 мм - с высокой окулярной точкой, широким полем зрения и с диоптрической настройкой (окулярная сетка – опция)
Объективы	полуапохроматический объектив для светлого и темного поля с увеличением 5X/10X/20X/50X/100X и наличием функции ДИК-микроскопии
	полуапохроматический объектив с большим рабочим расстоянием для светлого и темного поля с увеличением 20X и наличием функции ДИК-микроскопии
	полуапохроматический объектив с большим рабочим расстоянием для светлого и темного поля с увеличением 50X/100X
	полуапохроматический объектив для светлого поля с увеличением 5X/10X/20X/50X/100X и наличием функции ДИК-микроскопии
Револьверная головка	револьверная головка для светлого и темного поля с 5/6-ю объективами, оснащенными разъемами для ДИК-призмы
	револьверная головка для светлого поля с 6/7-ю объективами, оснащенными разъемами для ДИК-призмы
Рама	рама микроскопа для отраженного света с коаксиальным механизмом фокусировки с ходом 33 мм, точностью 0,001 мм, с регулировкой верхнего предела фокусировки, регулировкой усилия, со встроенным блоком питания с диапазоном напряжений 100В -240В и кнопкой установки и сброса интенсивности освещения
Столики	8-дюймовый трехуровневый механический столик размером 525мм X 330мм с рукояткой для быстрой коаксиальной регулировки с ходом 210мм X 210мм, стеклянная вставка
	6-дюймовый трехуровневый механический столик размером 445мм X 240мм с рукояткой для быстрой коаксиальной регулировки с ходом 158мм X 158мм, стеклянная вставка
Осветитель	Осветитель отраженного света с моторизованными, центрируемыми апертурой и полевой диафрагмой, с переключателем светлого и темного поля, слоты для фильтров и поляризационного комплекта

ПОЛЮС БАС

☎ +7 (499) 444-70-45

✉ info@polusbas.ru 🌐 www.polusbas.ru